

IEEE MILESTONE (16)

・First Practical Field Emission Electron Microscope, 1972

電界放出形電子顕微鏡の実用化

東京支部

日立は、シカゴ大学のアルバート・クリュー氏と共同で電界放出電子源の実用化技術を開発し、1972年、世界初の電界放出形電子顕微鏡を製品化した。この技術は、簡単な操作で安定度や信頼性の高い超分解能画像の観察を可能にした。電界放出形電子顕微鏡は、物理や生物、材料、半導体デバイスなどの分野の科学技術および産業の発展に非常に貴重な貢献をもたらした。

Citation (銘板に鑄込まれた碑文)

Hitachi developed practical field emission electron source technology in collaboration with Albert Crewe of the University of Chicago, and commercialized the world's first field emission scanning electron microscope in 1972. This technology enabled stable and reliable ultrahigh resolution imaging with easy operation. Field emission electron microscopes have made invaluable contributions to the progress of science, technology and industry in physics, biology, materials, and semiconductor devices.



世界に先駆けて実用化した HFS-2
電界放出形電子顕微鏡



左から日立ハイテク 久田社長、IEEE
Prof. Lawrence Wong、日立 中西社長



贈呈式の記念写真



日立ハイテク那珂地区に
展示された銘板

受賞の経過

- 1) Proposal Form提出：2010年2月27日、同承認：2010年5月19日
- 2) Nomination Form提出：2010年8月24日、History Committee承認：2011年3月6日
- 3) Board of Directors承認：2011年4月5日
- 4) 贈呈式、記念祝賀会：2012年1月31日、水戸プラザホテル
- 5) 記念講演会：2012年1月31日、(株)日立ハイテクノロジーズ那珂地区

IEEE マイルストーン認定 スペシャルサイト：<http://www.hitachi-hitec.com/ieee/index.html>